

## 産業技術総合研究所 生産計測技術研究センター

### 平成23年度 研究ユニット評価委員会 議事要旨

1. 日 時：平成23年12月2日（金） 12：45—18：00

2. 場 所：独立行政法人 産業技術総合研究所 九州センター 第1棟 2階 大会議室

#### 3. 議事

- (1) 開会挨拶 上田 完次 理事・評価部 部長  
(2) 委員紹介、資料確認 笹嶋 尚彦 評価部 研究評価推進室 総括主幹  
(3) 研究ユニット評価 一基本的考え方及び実施内容・方法一 遠藤 秀典 評価部 次長  
(4) ユニットによる説明（質疑含む）（議事進行：森田 瑞穂 評価委員長） 坂本 満 研究センター長 他  
(5) 総合討論、委員討議、全体講評（議事進行：森田 瑞穂 評価委員長）  
(6) 閉会挨拶 上田 完次 理事・評価部 部長

#### 4. 議事概要

##### (1) 研究ユニット評価概要説明

資料4に基づき、評価部より研究ユニット評価の概要について説明が行われた。

##### (2) 生産計測技術研究センターの説明と質疑応答

資料5及び研究センターからの説明資料に基づき、生産計測技術研究センターのユニット全体と4つのユニット戦略課題毎に説明が行われ、それぞれについて評価委員による質疑応答が行われた。また、生産計測技術研究センターのイノベーション推進への取り組みや研究ユニット運営の取り組みについて説明が行われ、評価委員による質疑応答が行われた。

##### (3) 全体を通しての質疑応答

生産計測技術研究センターの説明全般について総合討論が行われた。

##### (4) 委員討議、全体講評

今回の評価に関して、評価委員による討議が行われ、委員長はじめ外部・内部評価委員より実施者に対する講評が行われた。

#### 5. 出席者

##### [外部評価委員]

- 森田 瑞穂 大阪大学大学院工学研究科 精密科学・応用物理学専攻 教授 （評価委員長）  
大西 忠治 株式会社日鉄エレックス 取締役・技術管理部長  
尾形 仁士 三菱電機エンジニアリング株式会社 相談役  
河住 春樹 社団法人日本計量振興協会 専務理事  
澤田 廉士 九州大学工学研究院 システム生命科学専攻 教授

##### [内部評価委員]

- 檜野 良穂 首席評価役  
富樫 茂子 首席評価役

[研究ユニット：生産計測技術研究センター]

坂本 満 研究センター長  
菅原 孝一 副研究センター長／イノベーションコーディネータ  
野中 一洋 主幹研究員／光計測ソリューションチーム 研究チーム長  
上杉 文彦 プラズマ計測チーム 研究チーム長  
徐 超男 応力発光技術チーム 研究チーム長  
秋山 守人 プロセス計測チーム 研究チーム長  
菖蒲 一久 計測基盤技術チーム 研究チーム長  
松田 直樹 表面構造計測チーム 研究チーム長  
中村 浩之 マイクロ空間化学ソリューションチーム 主任研究員  
宮崎 真佐也 マイクロ空間化学ソリューションチーム 主任研究員  
大庭 英樹 表面構造計測チーム 主任研究員  
西村 武司 研究センター付〔主務：九州センター 九州研究業務推進室 主査〕  
山口 信介 産学官制度来所者（マイスターの説明及び質疑の時間のみ出席）

[研究統括、監事、副研究統括、分野研究企画室、所長]

一村 信吾 理事／標準・計測分野 研究統括  
内田 修 監事  
田中 充 標準・計測分野 副研究統括  
野中 秀彦 標準・計測分野研究企画室 研究企画室長  
浮辺 雅宏 標準・計測分野研究企画室 企画主幹  
堀部 雅弘 標準・計測分野研究企画室 企画主幹  
櫻井 めぐみ 標準・計測分野研究企画室 職員  
宇都 浩三 九州センター 所長  
犬養 吉成 九州センター 所長代理

[オブザーバー]

渡辺 一寿 イノベーション推進本部 イノベーションコーディネータ  
高松 孝行 イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 技術移転マネージャー

[事務局：評価部]

上田 完次 理事／評価部 部長  
遠藤 秀典 次長  
永壽 伴章 首席評価役  
手塚 明 審議役  
池上 徹 評価企画室 室長  
鈴木 理 研究評価推進室 室長  
笹嶋 尚彦 研究評価推進室 総括主幹  
加野 直巳 研究評価推進室 総括主幹

6. 配布資料

資料1：議事次第

資料2：出席予定者

資料3：座席表

資料4：平成23年度研究ユニット評価－基本的考え方及び実施内容・方法－

## 資料5：研究ユニット評価資料

### 生産計測技術研究センター 研究ユニット説明資料

#### 7. その他

研究ユニット評価委員会に先立ち、1) 超音波を利用した肉質判定技術、2) 光学的手法を主体とした製品検査・プロセス管理に関する計測技術、3) プラズマプロセスに関連する計測技術、の3箇所の見学会を実施した。